

基礎2：主にスクリーンで行う調整と視野探し

区分	チェック項目	内容	具体例	知識	実技	備考
TEMセンター：基礎	View	TEM System Task Bar			○	
		Lens/Deflector Monitor			○	
		Valve / Vacuum Monitor			○	
		Condition Monitor			○	
	Control	Beam			○	
		Illumination System			○	
		Specimen			○	
		Stage			○	
		Nanospace Map			○	
		Aperture			○	
		Image Forming System			○	
		Screen			○	
		Alignment Panel			○	
	Wobbler			○		
Application	HT Scheduling			○		
操作パネル・トラック ボール	操作盤L1			○		
	操作盤R1			○		
	操作盤L2			○		
	トラックボール			○		
	Z/TY/TX			○		
その他のインター フェース	EDS(SDD)コントローラー			○		
	ゴニオメーター			○		
	絞り（可動絞り）			○		
	像観察室			○		

区分	チェック項目	内容		具体例	知識	実技	備考
ゴニオ・試料移動・傾斜	X/Y/(Z) tiltX/TiltY	試料移動・傾斜ができること メカリミット・ソフトリミット				○	
	[TC]StageController	TC上で試料移動・傾斜				○	
	[TC]NanospaceMap	試料位置のメモリ・リコール				○	
絞り操作	[TC]ApertureController	TC上で絞りの設定確認・変更				○	
	集束絞り	CL絞りの挿抜・センタリング				○	
	制限視野絞り	制限視野絞りの挿抜・位置決				○	
	対物絞り（電動・インギャップ）	対物絞りの挿抜・位置決め				○	
	ハイコントラスト対物絞り					○	
	散乱X線防止絞り					○	
スクリーン	像モード	観察しやすい適切な明るさに調整できること。CCDに入力しても問題な				○	
	DIFFモード					○	
	小蛍光板/双眼鏡	小蛍光板と双眼鏡を使用して、像・DIFFのフォーカスあわせ				○	
観察モード（TEM：結像モード選択）	像モード	像モードに切替、適当な像を表示出来ること。				○	
	倍率変更	倍率変更とBrightness調整				○	
	DIFFモード	DIFFモードに切替、適当なDIFFパターンを表示出来ること				○	
	カメラ長変更	DIFFモードでカメラ長の変更とPLAlignができること。				○	
	IMAGE shift/PL Align	高倍像のImageShift/DIFFのセンタリング				○	

区分	チェック項目	内容		具体例	知識	実技	備考	
照射系調整	ビームセンタリング	像モードで、BeamAlign/GunAlignを用いてビームのセンタリング				○		
	コンデンサ非点補正	像モードで、CondStigを用いてビームの非点補正				○		
	Brightness調整	ブライツネスを調整出来ること。				○		
	SPOTサイズ選択	スポットサイズの変更とセンタリングができること。				○		
ビーム表示	スクリーンにビームを表示	電子線経路が絞リやTEMグリッドで塞がれていない。電子線が放出されている。適当な倍率とBrighetnessに設定されている。				○		
焦点合わせ	像観察モード	STDfocus	基準電圧を呼びだし			○		
		試料高さ	試料高さを調整			○		
		OBJFocus	電氣的にフォーカス調整			○		
		ImageWobbler	ImageWobblerで低～中倍のフォーカス合わせ			○		
		対物非点補正	試料のエッジで非点補正			○		
	DIFFモード	DIFF Focus					○	
		中間レンズ非点補正					○	
像観察 (基本)				スクリーンに目的の像を表示		○		
電子回折 (基本)				スクリーンに目的のDIFFを表示		○		